



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI
W DNIU 1 CZERWCA 2020 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Magdy Strączek.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.666.761 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,98 % kapitału zakładowego i dawały 4.666.761 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.666.761 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.666.761 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,98 % kapitału zakładowego i dawały 4.666.761 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.666.761 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia wybrać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w osobie Pani Magdaleny Bliźnickiej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.666.761 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,98 % kapitału zakładowego i dawały 4.666.761 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.666.761 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.666.761 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,98 % kapitału zakładowego i dawały 4.666.761 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.666.761 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) w § 6 dodaje się pkt 40 i 41 o następującym brzmieniu:
„40. PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego.
41. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.”
- 2) § 14 ust 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 14.7. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

3) § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 16.1. Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z nie mniej niż 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. W przypadku śmierci lub rezygnacji jednego z członków Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład i jednomyślną uchwałą wszystkich pozostałych członków dokooptować jednego nowego członka na okres do końca jej wspólnej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.666.761 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,98 % kapitału zakładowego i dawały 4.666.761 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.666.761 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

Działając na podstawie postanowienia § 15 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki VIII kadencji będzie się składać z 6 (sześciu) członków i dokonuje w tym zakresie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.666.761 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,98 % kapitału zakładowego i dawały 4.666.761 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.666.761 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, powołuje do składu Rady Nadzorczej trzyletniej wspólnej VIII kadencji Pana Daniela Reck.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.666.761 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,98 % kapitału zakładowego i dawały 4.666.761 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.666.761 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, powołuje do składu Rady Nadzorczej trzyletniej wspólnej VIII kadencji Pana Krystiana Kozakowskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 4.666.761 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 84,98 % kapitału zakładowego i dawały 4.666.761 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 4.666.761 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta.